



국민대학교 신소재공학부 학사과정에 재학중인 한영수(17) 학생이 지난 7월 7일부터 8일 사이 부산에서 개최된 2022 Asia-Pacific Workshop on Fundamentals and Applications of Advanced Semiconductor Devices (AWAD 2022)에서 최우수 포스터상(best award post)을 수상하였다. AWAD는 1993년부터 일본과 한국에서 번갈아 개최되어 왔으며, 올해가 29번째 워크숍이다. 워크숍에서 과학자와 엔지니어가

한자리에 모여 첨단 반도체 소자와 재료의 소자 가공 및 관련 기술에 대해 논의하고, 기초 물리학부터 최근 소자 성능 및 처리 기술 개선까지 반도체 소자와 재료 분야 전반을 다루었다.

국민대학교 신소재공학부 학사과정에 재학중인 한영수(17) 학생은 제 1저자로 ‘Treading Dislocation Density measurement of P-doped n-type Germanium on Si photoetching’라는 제목의 AWAD 2022 학회 발표를 했다. 이는  $n^{++}$  Ge on Si의 EPD(Etch Pit Density) 측정 방법 개발에 대한 내용이다.  $n^{++}$  Ge film의 품질 측정 이용될 것으로 기대된다.